

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表平11-506677

(43) 公表日 平成11年(1999) 6月15日

(51) Int. Cl.⁶

A 6 1 L 2/14
2/06

識別記号

F I

A 6 1 L 2/14
2/06

A

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 28 頁)

(21) 出願番号 特願平9-501539
(86) (22) 出願日 平成8年(1996) 6月5日
(85) 翻訳文提出日 平成9年(1997) 12月5日
(86) 国際出願番号 PCT/US.96/09150
(87) 国際公開番号 WO96/39199
(87) 国際公開日 平成8年(1996) 12月12日
(31) 優先権主張番号 08/491, 170
(32) 優先日 1995年6月6日
(33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 アプトックス・インコーポレイテッド
アメリカ合衆国イリノイ州 60060-3826、
ムンデレイン、テラス・ドライブ104
(72) 発明者 マーテンズ、フィリップ・エイ
アメリカ合衆国イリノイ州 60060-3826、
ムンデレイン、テラス・ドライブ104
(72) 発明者 レインウォーター、デビッド・エル
アメリカ合衆国ウィスコンシン州 53706、
マディソン、ユニヴァーシティ・アヴェニ
ュー1150、ユニヴァーシティ・オブ・ウィ
スコンシン
(74) 代理人 弁理士 竹内 澄夫 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマ水蒸気滅菌装置及び方法

(57) 【要約】

物品のプラズマ滅菌用装置は、プラズマ生成器、滅菌チャンバ、及びプラズマ生成器に流体連通する水蒸気のソースを含み、加圧滅菌器を選択的に含み得る。プラズマ滅菌方法は、滅菌されるべき物品を、水蒸気から生成されたプラズマの中性活動種に曝露する工程を含む。この物品のプラズマへの曝露は、滅菌に十分な時間の間、約32℃以下のチャンバ温度で、低圧で行われる。

